

高精度多功能奈米壓痕儀

G200X NANOINDENTER



設備第一負責人：李伯軒助理教授 TEL: 07-5252000 ext. 4285

E-mail: bsli@mail.nsysu.edu.tw

設備第二負責人：林勇志副教授 TEL: 07-5252000 ext. 6614

E-mail: yjlinsat@mail.nsysu.edu.tw

設備管理人：賴永裕經理 TEL: 07-5252000 ext. 6635

E-mail: laiyy@mail.nsysu.edu.tw

I 儀器資訊

1. 廠牌型號：KLA G200X
2. 購置年限：114 年 12 月
3. 放置地點：電資大樓地下室 半導體聯合實驗室 EC0006 (量測實驗室)
4. 應用功能：準靜態壓痕、動態壓痕、刮痕、映射、表面形貌掃描
5. 設備規格：
 - 最大負載：500 mN
 - Z 軸最大位移：1.5 mm
 - 負載/位移精度：50 nN/0.01 nm
 - 載台移動範圍：200x200 mm²
 - 物鏡放大倍率：x20, x40
 - 表面形貌掃描範圍：500x500 μm²
 - 動態壓痕測試頻率：0.1~1000 Hz
 - 動態壓痕負載振幅：0.01 μN~4.5 mN
 - 試片規格：直徑<30 mm，高度<3 mm，且表面粗糙度< 50 nm 之固體試片

II 自行操作

1. 經具設備特級使用者(super user)訓練後，且通過考核方可取得自行操作資格。(請參閱半導體聯合實驗室網頁>規章表單>設備操作辦法>自行操作資格取得辦法)
2. 通過考核後，可至半導體聯合實驗室網頁>儀器設備>設備分類>量測設備>高精度多功能奈米壓痕，進行預約及自行操作設備

III 委託操作

可至半導體聯合實驗室網頁>儀器設備>設備分類>量測設備>高精度多功能奈米壓痕進行預約，在於同網頁下載委託操作申請表，再將申請表寄至半導體聯合實驗室紀小姐(jlji26@mail.nsysu.edu.tw)進行委託代工服務。

IV 收費資訊

收費標準(單位:元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	800	1600
業界		4000

